

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 085 291 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
21.03.2001 Patentblatt 2001/12

(51) Int. Cl.⁷: G01B 5/00, G01B 11/30

(21) Anmeldenummer: 00119051.1

(22) Anmeldetag: 02.09.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:
Dr. Johannes Heidenhain GmbH
83292 Traunreut (DE)

(72) Erfinder: Spanner, Erwin
83278 Traunstein (DE)

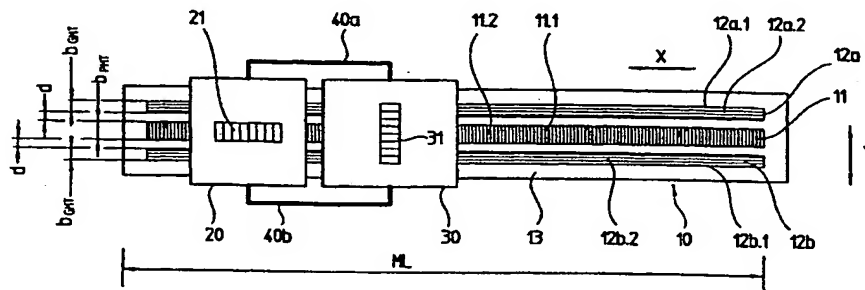
(30) Priorität: 16.09.1999 DE 19944395

(54) Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern angegeben. Diese umfaßt einen Maßstab mit einer in Positions-Meßrichtung angeordneten Positions-Meßteilung sowie beidseitig benachbart zur Positions-Meßteilung angeordneten Führungsfehler-Meßteilungen, die senkrecht zur Positions-Meßteilung angeordnet. Ferner ist eine Positionsbestimmungs-Abtasteinheit vorgesehen, die relativ gegenüber dem Maßstab beweglich ist und zur

Erzeugung von Positions-Meßsignalen die Meßteilung abtastet. Desweiteren gehört zur erfindungsgemäßen Vorrichtung mindestens eine Führungsfehler-Abtasteinheit, die zusammen mit der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit gegenüber dem Maßstab beweglich ist und zur Erzeugung von Führungsfehler-Meßsignalen die Führungsfehler-Meßteilungen abtastet.

FIG. 1



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern.

[0002] An modernen Präzisions-Werkzeugmaschinen oder Koordinatenmeßgeräten besteht mitunter die Forderung, neben der exakten Bestimmung der Position entlang einer Maschinenachse auch die eventuell vorliegenden Führungsfehler der jeweiligen Achse zu erfassen. Die meßtechnische Ermittlung von einem der verschiedenen Führungsfehler wird auch als Geradheitsmessung bezeichnet. Aus den gemessenen Führungsfehlern kann dann in einer geeigneten Auswerteinrichtung der jeweilige Positions-Meßwert im Betrieb rechnerisch korrigiert werden.

[0003] In der EP 0 082 244 A1 wird diese Problematik ausführlich diskutiert. Die Figuren 3 und 4 dieser Druckschrift zeigen ferner eine geeignete Vorrichtung, die es ermöglicht sowohl über eine hochauflösende Inkrementalmessung die jeweilige Position entlang einer Achse zu bestimmen als auch die oben erwähnte Ermittlung von Führungsfehlern bzw. auch die Geradheitsmessung durchzuführen. Hierzu ist ein Maßstab vorgesehen, der neben einer Positions-Meßteilung in Form einer herkömmlichen Inkrementalteilung in Meßrichtung auch eine senkrecht dazu angeordnete Führungsfehler-Meßteilung umfaßt. Die Führungsfehler-Meßteilung besteht aus Teilungsstrichen, die parallel zur Meßrichtung orientiert sind und sich über den Eckbereich eines Trägerkörpers mit quadratischem Querschnitt erstrecken. Zur Abtastung der verschiedenen Meßteilungen sind photoelektrische Meßsysteme erwähnt, auf die jedoch nicht weiter eingegangen wird.

[0004] Eine weitere Vorrichtung zur gleichzeitigen Positions- und Führungsfehlermessung ist aus der EP 0 660 085 A1 bekannt. Hierbei wird eine Maßverkörperung mit Hilfe einer CCD-Zeile abgetastet, wobei die Maßverkörperung mehrere Spuren umfaßt. Symmetrisch benachbart zu einer mittleren nichtperiodischen Strichcode-Struktur sind zwei Spuren mit Strichen angeordnet, die parallel zur Meßrichtung orientiert sind. Die Abtastung der letztgenannten beiden Spuren, die senkrecht zur eigentlichen Meßrichtung ausgerichtet sind, ermöglicht wiederum die Erfassung von eventuellen Führungsfehlern bzw. die Geradheitsmessung. Die absolute Positionsbestimmung erfolgt hierbei jedoch mit einer relativ groben Auflösung; für Hochpräzisionsanwendungen ist diese Vorrichtung daher nicht geeignet.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern anzugeben, die ausgehend von einer herkömmlichen hochauflösenden Positionsmeßeinrichtung möglichst wenige Modifikationen erfordert, um auch eine hochpräzise Ermittlung von Führungsfehlern entlang mindestens einer vorgegebenen Achse vorzunehmen.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-

richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0007] Vorteilhafte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich aus den Maßnahmen, die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführt sind.

[0008] Erfindungsgemäß wurde nunmehr eine hochauflösende Positionsmeßeinrichtung, wie sie z.B. aus der EP 0 387 520 B1 bekannt ist, dahingehend modifiziert, daß auch eine gleichzeitige Ermittlung von Führungsfehlern damit möglich ist. Auf Seiten des Maßstabes der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind benachbart zu einer üblichen Positions-Meßteilung in Form einer Inkrementalteilung mindestens zwei Führungsfehler-Meßteilungen angeordnet, die jeweils senkrecht zur Positions-Meßteilung orientiert sind. Zur Abtastung der verschiedenen Meßteilungen sind vorzugsweise zwei identisch ausgebildete Abtasteinheiten vorgesehen, die lediglich um 90° verdreht zueinander anzuordnen sind. Eine der beiden Abtasteinheiten dient als Positionsbestimmungs-Abtasteinheit, die in bekannter Art und Weise die Positions-Meßteilung in Meßrichtung zur Erzeugung von Positions-Meßsignalen abtastet. Die zweite Abtasteinheit fungiert als Führungsfehler-Abtasteinheit tastet zur Erzeugung von Führungsfehler-Meßsignalen die Führungsfehler-Meßteilungen ab. Die Führungsfehler-Abtasteinheit ist zusammen mit der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit entlang der Meßrichtung gegenüber dem Maßstab beweglich.

[0009] Im Vergleich zur bekannten Positionsmeßeinrichtung aus der EP 0 387 520 B1 ist demnach lediglich die zusätzliche Anordnung der beiden Führungsfehler-Meßteilungen auf dem Maßstab sowie eine zweite — identische — Abtasteinheit erforderlich, um nunmehr in einer Vorrichtung sowohl die Positionsbestimmung als auch die Ermittlung der Führungsfehler zu bewerkstelligen.

[0010] Sowohl die Erzeugung der Positions-Meßsignale als auch die Erzeugung der Führungsfehler-Meßsignale basiert auf einem interferentiellen Abtastprinzip, d.h. es ist für beide Messungen jeweils eine entsprechend hohe Auflösung bzw. Präzision sichergestellt.

[0011] Desweiteren erweist sich die Anordnung der Positions-Meßteilung und der beiden Führungsfehler-Meßteilungen auf dem Maßstab als äußerst platzsparend, d.h. es sind auch auf Seiten des Maßstabes keine großen Bauvolumina erforderlich.

[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung läßt sich ferner in vielfältiger Form modifizieren bzw. erweitern; beispielsweise durch Hinzufügen weiterer Abtasteinheiten zur Erfassung weiterer Führungsfehler oder Nutzung alternativer Abtastprinzipien etc...

[0013] Weitere Vorteile sowie Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung mehrerer Ausführungsbeispiele anhand der beiliegenden Zeichnungen.

[0014] Dabei zeigt

- Figur 1 eine schematisierte Draufsicht auf eine erste Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung;
- Figur 2 eine perspektivische Ansicht des Maßstabes und von Teilen der Führungsfehler-Abtasteinheit des Beispiels aus Figur 1;
- Figur 3 den Strahlengang zur Führungsfehlermessung in einem zweiten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0015] In Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Draufsicht schematisch dargestellt. Hierbei sind insbesondere auf Seiten der jeweiligen Abtasteinheiten 20, 30 aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit nicht alle Elemente gezeigt.

[0016] Wie in Figur 1 erkennbar, umfaßt die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern einen Maßstab 10 sowie zwei gegenüber dem Maßstab 10 in einer Meßrichtung x bewegliche Abtasteinheiten 20, 30. In der Praxis ist hierbei der Maßstab 10 gegenüber den beiden Abtasteinheiten 20, 30 beweglich angeordnet; wesentlich ist jedoch lediglich mögliche Relativbewegung von Maßstab 10 und Abtasteinheiten 20, 30. Die beiden Abtasteinheiten 20, 30 seien nachfolgend als Positionsbestimmungs-Abtasteinheit 20 bzw. Führungsfehler-Abtasteinheit 30 bezeichnet. Beide Abtasteinheiten 20, 30 sind zusammen miteinander gegenüber dem Maßstab 10 beweglich — oder umgekehrt — und hierzu etwa in einem — nicht dargestellten — Gehäuse angeordnet. Grundsätzlich kann die gemeinsame Beweglichkeit der beiden Abtasteinheiten 20, 30 gegenüber dem Maßstab 10 selbstverständlich auch anderweitig hergestellt werden, etwa durch geeignete mechanische Kopplungselemente etc.. In Figur 1 sei die zwangsweise gemeinsame Bewegung der beiden Abtasteinheiten 20, 30 durch die Kopplungselemente 40a, 40b schematisch angedeutet.

[0017] Der Maßstab 10 und die beiden Abtasteinheiten 20, 30 sind beispielsweise mit Maschinenkomponenten verbunden, die relativ zueinander in Meßrichtung x beweglich sind. Neben der hochpräzisen Relativposition sollen auch die maschinenseitigen Führungsfehler entlang der jeweiligen Meßlänge ML über die erfindungsgemäße Vorrichtung bestimmt werden. Die von den beiden Abtasteinheiten 20, 30 im Fall der Relativbewegung zum Maßstab 20 erzeugten Positions- und Führungsfehler-Meßsignale werden zur Weiterverarbeitung einer — nicht dargestellten — Auswerteeinheit zugeführt. Auf die konkrete Auswertung bzw. Weiterverarbeitung der erzeugten Signale sei an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, sondern z.B. lediglich auf die bereits oben erwähnte EP 0 082 441 A1 verwiesen.

[0018] Der Maßstab 10 der erfindungsgemäßen

Vorrichtung ist in dieser Ausführungsform als Reflexions-Maßstab ausgebildet, d.h. die verschiedenen darauf angeordneten Meßteilungen 11, 12a, 12b sind jeweils als bekannte Reflexions-Meßteilungen in Form von Reflexions-Phasenteilungen ausgebildet. Derartige Reflexions-Meßteilungen bestehen aus in der jeweiligen Meßrichtung x alternierend angeordneten Teilbereichen 11.1, 11.2, 12a.1, 12a.2, 12b.1, 12b.2 mit unterschiedlichen Stufenhöhen. Im Fall der Reflexions-Phasenteilung handelt es sich etwa um periodisch angeordnete strichförmige, reflektierende Teilbereiche 11.1, 12a.1, 12b.1 bzw. Striche aus Gold, die auf einer reflektierenden Oberfläche angeordnet sind, z.B. ebenfalls Gold. Die zwischen den Strichen angeordneten Teilbereiche 11.2, 12a.2, 12b.2 seien nachfolgend als Lücken bezeichnet.

[0019] Auf dem Maßstab 10 der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist im dargestellten Ausführungsbeispiel auf der Oberseite eines Trägerelementes 13 mittig eine Positions-Meßteilung 11 vorgesehen, bestehend aus periodisch in Meßrichtung x angeordneten, hochreflektierenden Strichen 11.1 und Lücken 11.2. Die Längsrichtung der Striche 11.1 bzw. Lücken 11.2 ist hierbei senkrecht zur Meßrichtung x orientiert, die entsprechende Richtung sei als y -Richtung definiert. Die Länge der Striche 11.1 entspricht der Breite b_{PMT} der Spur mit der Positions-Meßteilung 11. Die Teilungsperiode der Positions-Meßteilung 11 wird mit TP_{PMT} bezeichnet.

[0020] Beidseitig benachbart zur Positions-Meßteilung 11 sind in der dargestellten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zwei Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b auf dem Trägerelement 13 des Maßstabes 10 vorgesehen. Die Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b sind hierbei senkrecht zur Positions-Meßteilung 11 angeordnet. Dies bedeutet, daß sich die Striche 12a.1, 12a.2 bzw. Stege und Lücken 12a.2, 12b.2 der beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b parallel zur Meßrichtung x über die gesamte Meßlänge ML erstrecken. Die Breite der beiden Spuren mit den Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b ist identisch gewählt und wird nachfolgend mit b_{GMT} bezeichnet; der Abstand der beiden Spuren mit den Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b zur mittigen Spur mit der Positions-Meßteilung 11 sei jeweils mit d bezeichnet. Beide Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b weisen die gleiche Teilungsperiode TP_{GMT} auf. Grundsätzlich könnten die beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b auch unmittelbar anschließend an die mittige Positions-Meßteilung 11 angeordnet werden, d.h. $d = 0$ gewählt werden.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Teilungsperioden TP_{PMT} , TP_{GMT} der verschiedenen Meßteilungen 11, 12a, 12b allesamt identisch ausgebildet.

[0022] Die Erzeugung der Abtastsignale mit Hilfe der beiden Abtasteinheiten 20, 30 basiert jeweils auf einem interferentiellen Wirkungsprinzip, wie es bei-

spielsweise in der EP 0 387 520 B1 der Anmelderin ausführlich beschrieben ist. Ein entsprechendes Meßsystem wird von der Anmelderin unter der Produktbezeichnung LIP 382 vertrieben. In Bezug auf die Signalerzeugung sei an dieser Stelle deshalb lediglich auf die oben erwähnte Druckschrift verwiesen.

[0023] Von den verschiedenen Komponenten der Abtasteinheiten 20, 30 sind in Figur 1 aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit lediglich die jeweiligen Abtasteilungen 21, 22 dargestellt. Aus der gezeigten Orientierung der Abtasteilungen 21, 31 relativ zu den verschiedenen Teilungen 11, 12a, 12b auf dem Maßstab 10 ist ersichtlich, daß die linke Abtasteinheit 20 zur Abtastung der Positions-Teilung 11 dient. Die Abtasteilung 21 der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit 20 ist zu diesem Zweck identisch zur Positions-Meßteilung 11 auf dem Maßstab 10 orientiert. Im Fall der Relativbewegung in Meßrichtung x werden demzufolge über die Positionsbestimmungs-Abtasteinheit 20 periodisch modulierte Inkrementalsignale mit der Signalperiode $TP_{PMT}/4$ erzeugt, die in bekannter Art und Weise weiterverarbeitet werden können. Die derart erzeugten Positions-Meßsignale dienen demnach zur präzisen Bestimmung der Relativposition der Abtasteinheit 20 gegenüber dem Maßstab 10 in Meßrichtung x und ist demzufolge identisch zur bekannten Variante aus der EP 0 387 520 B1.

Im Fall der Verwendung des oben genannten LIP 382-Systemes liegt eine Teilungsperiode $TP_{MT} = 0.512\mu m$ und eine resultierende Signalperiode der inkrementalen Positions-Meßsignale von $0.128\mu m$ vor.

[0024] In Meßrichtung x etwas versetzt und senkrecht zur Positionsbestimmungs-Abtasteinheit 20 ist die Führungsfehler-Abtasteinheit 30 angeordnet. Entsprechend um 90° gegenüber der Abtasteilung 21 der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit 20 verdreht, d.h. in y-Richtung, ist demzufolge auch die Abtasteilung 31 dieser Abtasteinheit 30 angeordnet, d.h. identisch zur Orientierung der beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b auf dem Maßstab 10. Resultiert im Fall der Bewegung in Meßrichtung x nunmehr aufgrund eventueller Führungsfehler auch eine Relativbewegung in y-Richtung, d.h. senkrecht zur Meßrichtung x, so wird diese Bewegung mit Hilfe der Führungsfehler-Abtasteinheit 30 präzise bestimmt. Die Führungsfehler-Meßsignale stellen im Fall der eventuellen Relativbewegung in y-Richtung ebenfalls periodisch modulierte Inkrementalsignale dar, die aufgrund der Abtastung der beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b die Signalperiode $TP_{GMT}/4$ aufweisen. Auch diese Signale werden in bekannter Art und Weise von der oben erwähnten Auswerteeinheit weiterverarbeitet. Wenn wie oben erwähnt die Teilungsperioden aller beteiligten Meßteilungen 11, 12a, 12b identisch gewählt werden, liegt im Fall der Verwendung des LIP 382-Systemes und $TP_{GMT} = 0.512\mu m$ eine Signalperiode der inkrementalen Führungsfehler-Meßsignale von $0.128\mu m$ vor.

[0025] Durch eine entsprechende Dimensionierung

der Breiten b_{GMT} , b_{PMT} der verschiedenen Teilungsspuren 11, 12a, 12b sowie der Abstände d auf dem Maßstab 10 läßt sich nunmehr sicherstellen, daß zwei identisch ausgebildete Abtasteinheiten 20, 30, die auf dem bekannten Prinzip aus der EP 0 387 520 B1 basieren, einsetzbar sind. Diese müssen lediglich um 90° verdreht zueinander angeordnet werden. Daneben sind nur zusätzlich die beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b auf dem Maßstab 10 erforderlich. Ohne großen Mehraufwand läßt sich somit das bekannte Meßsystem aus der EP 0 387 520 B1 zur erfindungsgemäßen Vorrichtung umfunktionieren.

[0026] Alternativ zur Anordnung von zwei separaten Führungsfehler-Abtasteinheiten 20, 30 gemäß dem oben erläuterten Beispiel läßt sich die erfindungsgemäße Vorrichtung auch abwandeln. So ist es z.B. auch möglich die optische Funktion der beiden Abtasteinheiten in einer einzigen Abtasteinheit zu integrieren, die gegenüber dem Maßstab beweglich ist oder umgekehrt. In diesem Fall ließe sich insbesondere ein noch kompakteres System auf der Abtastseite realisieren.

[0027] In Figur 2 ist eine weitere schematische Teildarstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer perspektivischen Ansicht gezeigt. Dargestellt sind hierbei lediglich einige der Komponenten der Führungsfehler-Abtasteinheit 30 aus Figur 1, um die räumliche Orientierung der verschiedenen Komponenten bzw. den Abtaststrahlengang bei der Führungsfehlermessung besser zu veranschaulichen. Die in Figur 2 nicht gezeigte Positionsbestimmungs-Abtasteinheit umfaßt wie vorher erläutert die identischen Komponenten, die allerdings um 90° verdreht zu den dargestellten Komponenten in Figur 2 angeordnet sind.

[0028] Die jeweiligen Abtasteinheiten umfassen demzufolge eine Lichtquelle 32, eine Kollimatoroptik 35, ein Abtastgitter 31, eine Retroreflexions-Baueinheit 33 sowie mehrere Detektorelemente 34a, 34b, 34c. Die von der Lichtquelle 32 emittierten Strahlenbündel werde mit Hilfe der Kollimatoroptik 35 zunächst kollimiert, ehe diese auf die als Transmissionsteilung ausgebildete Abtasteilung 31 gelangen. Dort erfolgt eine Aufspaltung der einfallenden Strahlenbündel in mehrere Teilstrahlenbündel verschiedener Beugungsordnungen. Zumindest zwei Beugungsordnungen, vorzugsweise die ± 1 . Ordnungen, treffen anschließend auf die Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b, werden dort erneut gebeugt und in Richtung der Retroreflexions-Baueinheit 33 reflektiert. Der Mittenabstand der beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b ist in diesem Ausführungsbeispiel demnach so zu wählen, daß er dem Abstand der auf den Maßstab auftreffenden Beugungsordnungen entspricht. Die optische Auslegung der Retroreflexions-Baueinheit 33 gewährleistet, daß die einfallenden Teilstrahlenbündel wieder in Richtung der beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b reflektiert werden. Die Retroreflexionsbaueinheit 33 ist als geeignet dimensioniertes Tripelprisma oder als eine optisch entsprechende Tripelspiegel-Anordnung ausge-

bildet; bzgl. weiterer Details sei in diesem Zusammenhang auf die EP 0 387 520 B1 verwiesen. Nach der erneuten Reflexion an den beiden Führungsfehler-Meßteilungen 12a, 12b treffen die verschiedenen Teilstrahlenbündel schließlich erneut auf die Abtasteinheit 31, die letztlich die Paare interferierender Teilstrahlenbündel in verschiedenen Raumrichtungen zu den insgesamt drei Detektorelementen 34a, 34b, 34c hin ablenkt. An den drei Detektorelementen 34a, 34b, 34c liegen im Fall der Relativbewegung der Führungsfehler-Abtasteinheit 30 gegenüber dem Maßstab 10 in y-Richtung ausgangsseitig dann schließlich periodisch modulierte Inkrementalsignale. Zwischen den Signalen an den drei Detektorelementen 34a, 34b, 34c liegt hierbei ein Phasenversatz von 120° vor.

[0029] Ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung sei nachfolgend anhand von Figur 3 erläutert. Während das erste beschriebene Ausführungsbeispiel als Auflicht-System ausgelegt war, sei anhand von Figur 3 veranschaulicht, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung selbstverständlich auch als Durchlicht-System ausgebildet werden kann. Figur 3 zeigt hierbei eine Schnittdarstellung des Maßstabes 100 und der Führungsfehler-Abtasteinheit 300 in der y-z-Ebene, um insbesondere den Abtaststrahlengang der Führungsfehler- bzw. in diesem Fall der Geradheitsmessung zu erläutern. Maßstab 100 und Abtasteinheit 300 sind in Meßrichtung x zueinander beweglich angeordnet. In Bezug auf die — nicht dargestellte — Anordnung der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit sei etwa auf die Figur 2 in der EP 0 387 520 B1 verwiesen, die die Verhältnisse im Abtaststrahlengang zur Positionsmessung in der x-z-Ebene zeigt.

[0030] Auf Seiten des Maßstabes 100 sind wiederum auf einem nunmehr transparenten Trägerelement 113 eine mittig angeordnete Positions-Meßteilung 111 sowie beidseitig benachbarte Führungsfehler-Meßteilungen 112a, 112b vorgesehen. Die jeweiligen Teilungen 111, 112a, 112b sind nunmehr im Durchlicht-System als Transmissions-Teilungen, vorzugsweise als Phasen-Transmissionsteilungen, ausgebildet. Wie etwa im Schnitt der beiden Führungsfehler-Meßteilungen erkennbar, bestehen diese aus periodisch angeordneten Stegen und Lücken in der jeweiligen Meßrichtung, wobei Stege und Lücken unterschiedliche Stufenhöhen aufweisen.

[0031] Die Führungsfehler-Abtasteinheit 300 umfaßt wie im vorhergehenden Ausführungsbeispiel eine Lichtquelle 132, eine Kollimatoroptik 135, eine Abtasteinheit 131, eine als Tripelprisma ausgebildete Retroreflexions-Baueinheit 133 sowie drei optoelektronische Detektorelemente 134a, 134b, 134c. Die aus der Lichtquelle 132 austretenden und von der Kollimatoroptik 135 parallel gerichteten Strahlenbündel gelangen zunächst wiederum auf die Abtasteinheit 131, wo diese in verschiedene Teilstrahlenbündel gebeugt bzw. aufgespalten werden. Anschließend treffen die gebeugten Teilstrahlenbündel auf die jeweiligen Führungsfehler-

Meßteilungen 112a, 112b auf dem Maßstab 100 und werden von diesen nunmehr in Transmission nochmals gebeugt. Nach Rückreflexion durch die Retroreflexions-Baueinheit 133 durchlaufen die Teilstrahlenbündel wiederum die beiden Führungsfehler-Meßteilungen 112a, 112b, ehe in der Ebene der Abtasteinheit 131 schließlich interferenzfähige Paare von Teilstrahlenbündeln vorliegen. Mit Hilfe der Abtasteinheit 131 erfolgt schließlich eine Ablenkung der jeweils interferierenden Teilstrahlenbündel in Richtung der Detektorelemente 134a, 134b, 134c, wo im Fall der Relativbewegung von Maßstab 100 und Führungsfehler-Abtasteinheit 300 in y-Richtung phasenverschobene Inkrementalsignale anliegen.

[0032] Neben dieser zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind selbstverständlich auch noch weitere Alternativen im Rahmen der vorliegenden Erfindung realisierbar. So wäre es beispielsweise möglich, auch das aus der EP 0 311 144 B1 bekannte Abtastprinzip auf Seiten der jeweiligen Abtasteinheiten einzusetzen, um die verschiedenen Abtastsignale zu erzeugen. Auch in diesem Fall wäre lediglich eine zweite, identische Abtasteinheit erforderlich, die um 90° verdreht zur üblichen Abtasteinheit angeordnet wird und die beiden ebenfalls zusätzlichen Führungsfehler-Meßteilungen abtastet, die benachbart zur Positions-Meßteilung auf dem Maßstab anzuordnen wären.

[0033] Auch andere bekannte Abtastprinzipien lassen sich mit geringfügigen Modifikationen entsprechend anpassen und im Rahmen der vorliegenden Erfindung einsetzen.

[0034] Desweiteren läßt sich die erfindungsgemäße Vorrichtung selbstverständlich dahingehend abwandeln, daß damit auch weitere Führungsfehler erfaßt werden können, beispielsweise Führungsfehler, die auf Drehungen um bestimmten Achsen beruhen. Hierzu sind dann entsprechend zusätzliche Führungsfehler-Abtasteinheiten bzw. Führungsfehler-Meßteilungen vorzusehen wie dies etwa in den Figuren 3 und 5 der bereits oben erwähnten EP 0 082 441 vorgeschlagen wurde usw..

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern, bestehend aus

- einem Maßstab (10; 100) mit einer in Positions-Meßrichtung (x) angeordneten Positions-Meßteilung (11; 111) sowie beidseitig benachbart zur Positions-Meßteilung (11; 111) angeordneten Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b; 112a, 112b), die senkrecht zur Positions-Meßteilung (x) angeordnet sind,
- einer Positionsbestimmungs-Abtasteinheit (20, 30), wobei diese und der Maßstab (10; 100) relativ zueinander beweglich sind und die Posi-

- tionsbestimmungs-Abtasteinheit (20, 30) zur Erzeugung von Positions-Meßsignalen die Positions-Meßteilung (11; 111) abtastet sowie mindestens einer Führungsfehler-Abtasteinheit (30; 300), wobei die Führungsfehler-Abtasteinheit (30; 300) zusammen mit der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit (20) relativ gegenüber dem Maßstab (10; 100) beweglich ist und zur Erzeugung von Führungsfehler-Meßsignalen die mindestens eine Führungsfehler-Abtasteinheit (30; 300) die Führungsfehler-Meßteilungen (11; 111) abtastet.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die beiden Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b; 112a, 112b) jeweils die identische Teilungsperiode wie die Positions-Meßteilung (11; 111) aufweisen und sich über die gesamte Meßlänge (ML) erstrecken.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Positions-Meßteilung (11; 111) sowie die Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b; 112a, 112b) auf der Oberfläche eines gemeinsamen Trägerelementes (13; 113) angeordnet sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Positions-Meßteilung (11) sowie die Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b) jeweils als Reflexions-Meßteilungen ausgebildet sind.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Positionsbestimmungs-Abtasteinheit (20) und die Führungsfehler-Abtasteinheit (30; 300) identisch ausgebildet und senkrecht zueinander angeordnet sind.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Positionsbestimmungs-Abtasteinheit (20) und/oder die Führungsfehler-Abtasteinheit (30; 300) eine Lichtquelle (32; 132), eine Abtastteilung (21, 31; 131), eine Retroreflexions-Baueinheit (33; 133) sowie mehrere Detektorelemente (34a, 34b, 34c; 134a, 134b, 134c) umfassen.
7. Vorrichtung nach Anspruch 4 und 6, wobei die Führungsfehler-Abtasteinheit (20) derart ausgebildet und in Bezug auf die beiden Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b) derart angeordnet ist, daß die von der Lichtquelle (32) emittierten Strahlenbündel zunächst die Abtastteilung (31) durchlaufen, anschließend auf die Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b) auftreffen und von dort in Richtung der Retroreflexions-Baueinheit (33) zurückreflektiert werden, die die einfallenden Strahlenbündel in Richtung der Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b) zurückreflektiert, von wo wiederum eine Reflexion in Richtung der Abtastteilung (31) erfolgt, ehe die Strahlenbündel auf die Detektorelemente (34a, 34b, 34c) auftreffen.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die jeweiligen Breiten der beiden Führungsfehler-Meßteilungen (12a, 12b) und der Positionsbestimmungs-Meßteilung (11) senkrecht zur Positions-Meßrichtung (x) derart dimensioniert sind, daß identisch ausgebildete Positionsbestimmungs-Abtasteinheiten (20) und Führungsfehler-Abtasteinheiten (30) verwendbar sind.
9. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Positionsbestimmungs-Abtasteinheit und die Führungsfehler-Abtasteinheit in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind, welches gegenüber dem Maßstab beweglich in der Positions-Meßrichtung angeordnet ist.

FIG. 1

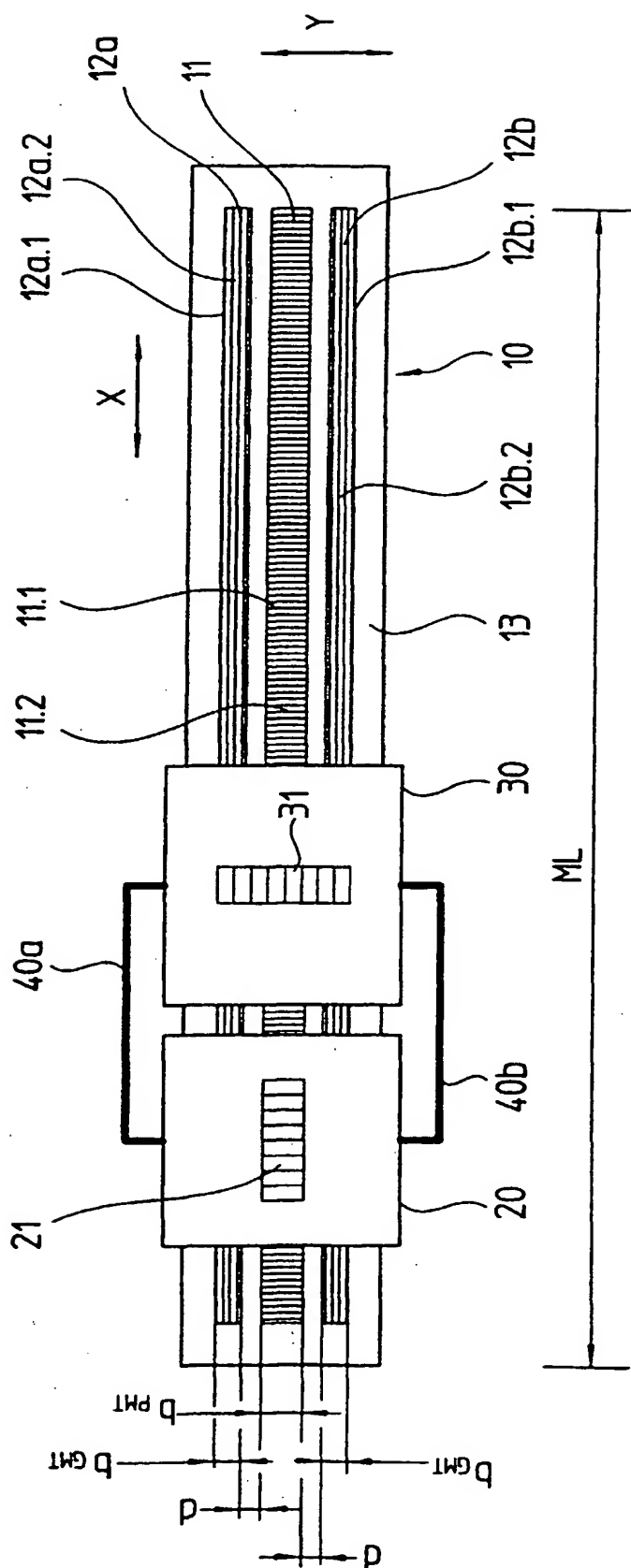


FIG. 2

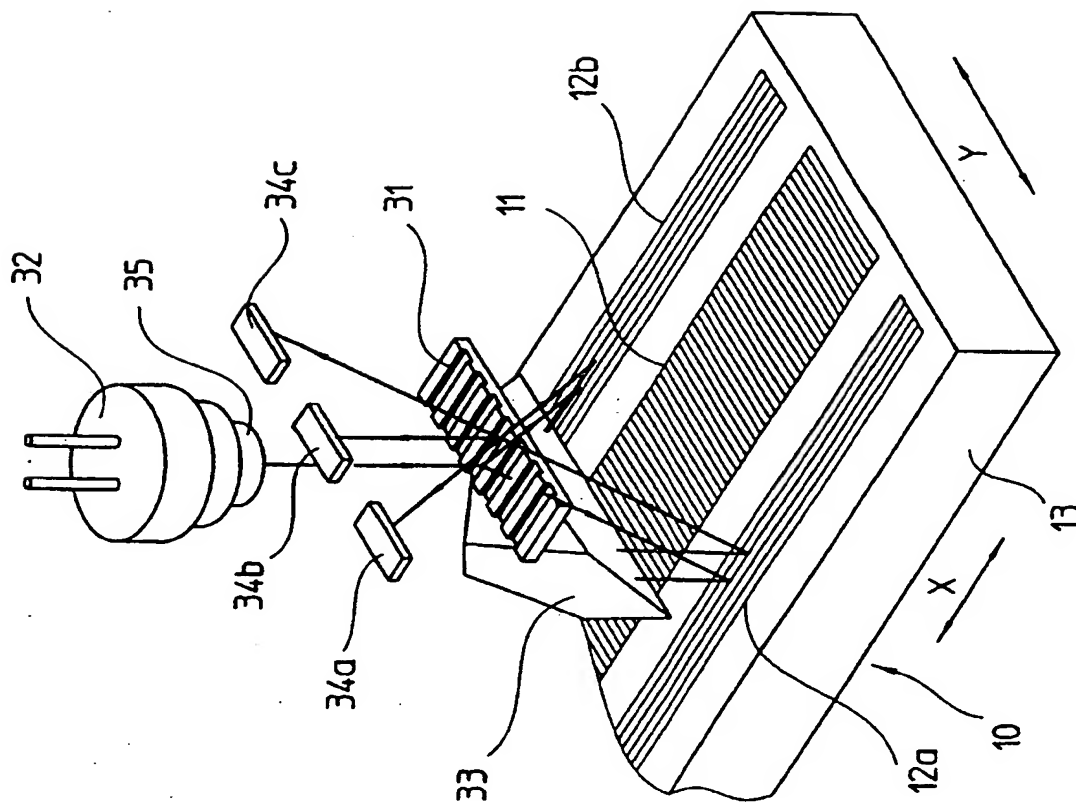
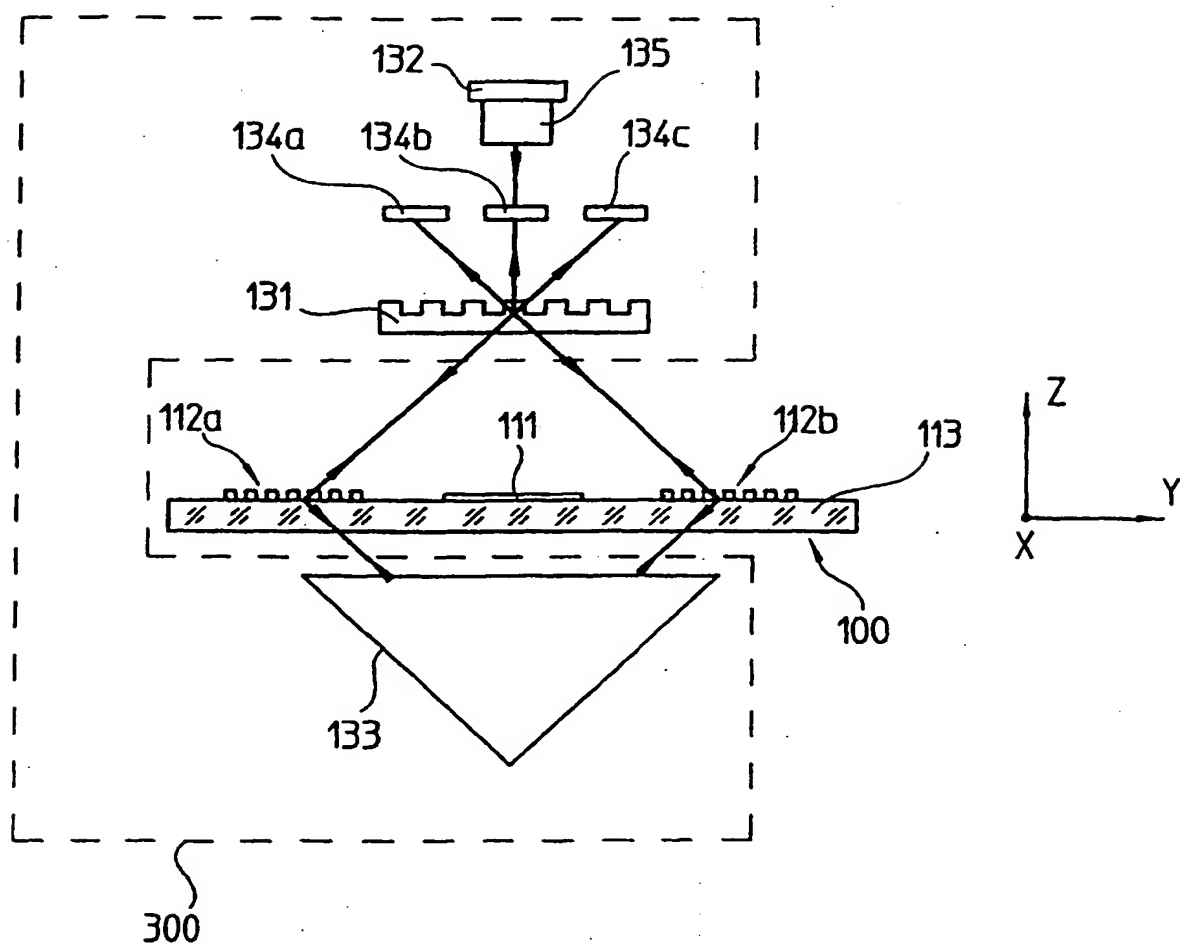
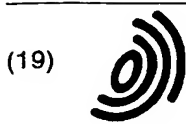


FIG. 3





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 085 291 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
07.01.2004 Patentblatt 2004/02

(51) Int Cl.7: G01B 5/00, G01B 11/30,
G01D 5/347, G01D 5/38

(43) Veröffentlichungstag A2:
21.03.2001 Patentblatt 2001/12

(21) Anmeldenummer: 00119051.1

(22) Anmeldetag: 02.09.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: Dr. Johannes Heidenhain GmbH
83292 Traunreut (DE)

(72) Erfinder: Spanner, Erwin
83278 Traunstein (DE)

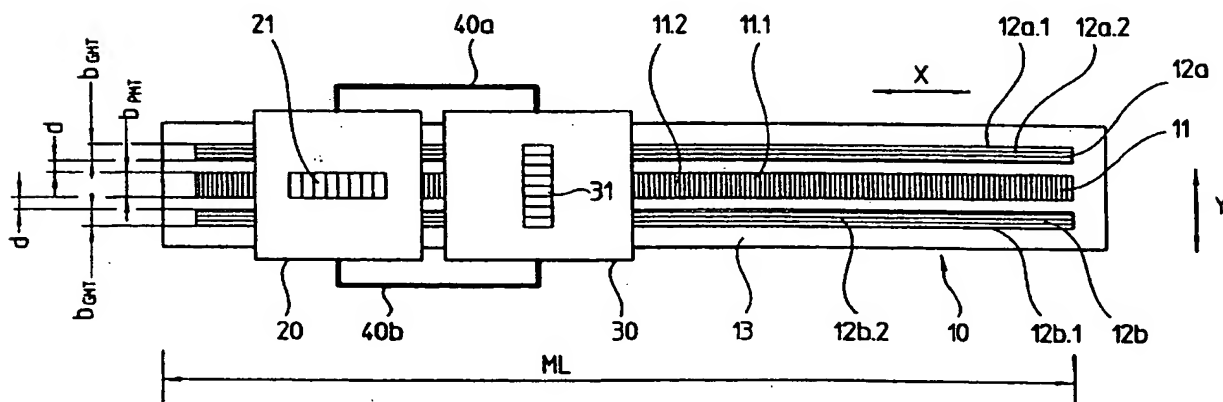
(30) Priorität: 16.09.1999 DE 19944395

(54) Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Positionsbestimmung und Ermittlung von Führungsfehlern angegeben. Diese umfaßt einen Maßstab mit einer in Positions-Meßrichtung angeordneten Positions-Meßteilung sowie beidseitig benachbart zur Positions-Meßteilung angeordneten Führungsfehler-Meßteilungen, die senkrecht zur Positions-Meßteilung angeordnet. Ferner ist eine Positionsbestimmungs-Abtasteinheit vorgesehen, die

relativ gegenüber dem Maßstab beweglich ist und zur Erzeugung von Positions-Meßsignalen die Meßteilung abtastet. Desweiteren gehört zur erfindungsgemäßen Vorrichtung mindestens eine Führungsfehler-Abtasteinheit, die zusammen mit der Positionsbestimmungs-Abtasteinheit gegenüber dem Maßstab beweglich ist und zur Erzeugung von Führungsfehler-Meßsignalen die Führungsfehler-Meßteilungen abtastet.

FIG. 1





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 9051

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 061 073 A (MICHEL DIETER) 29. Oktober 1991 (1991-10-29) * Spalte 1, Zeile 37 - Spalte 2, Zeile 3; Abbildungen 1,2,3A,3 * * Spalte 2, Zeile 38 - Zeile 55 * * Spalte 3, Zeile 23 - Zeile 65 *	1,3	G01B5/00 G01B11/30 G01D5/347 G01D5/38
X,D	EP 0 082 441 A (ZEISS CARL FA) 29. Juni 1983 (1983-06-29) * Abbildungen 1,3,4 * * Ansprüche 2,4,7 * * Seite 7, Zeile 8 - Zeile 35 *	1-6	
A	DE 43 03 161 A (ZEISS CARL FA) 11. August 1994 (1994-08-11) * Abbildungen 1-3 * * Ansprüche 1,2,4-7 * * Spalte 1, Zeile 47 - Zeile 62 * * Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 3, Zeile 39 *	1-9	
A,D	EP 0 387 520 A (HEIDENHAIN GMBH DR JOHANNES) 19. September 1990 (1990-09-19) * Abbildungen 1-3 * * Ansprüche 1,4-7 * * Spalte 1, Zeile 48 - Zeile 62 * * Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 3, Zeile 39 *	1-9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) G01D G01B B23Q
A	US 4 758 720 A (AUBELE KARL-EUGEN ET AL) 19. Juli 1988 (1988-07-19) * Abbildung 1 * * Spalte 2, Zeile 51 - Spalte 3, Zeile 12 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 17. November 2003	
		Prüfer FABER-JURK, S	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 9051

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-11-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5061073 A	29-10-1991	DE 3834676 A1	19-04-1990
		DE 58902613 D1	10-12-1992
		EP 0363620 A1	18-04-1990
		JP 1982036 C	25-10-1995
		JP 2129518 A	17-05-1990
		JP 7011433 B	08-02-1995
EP 0082441 A	29-06-1983	DE 3150977 A1	30-06-1983
		DE 3278781 D1	25-08-1988
		EP 0082441 A2	29-06-1983
		JP 1645646 C	13-03-1992
		JP 3010042 B	12-02-1991
		JP 58113805 A	06-07-1983
		US 4587622 A	06-05-1986
DE 4303161 A	11-08-1994	DE 4303161 A1	11-08-1994
EP 0387520 A	19-09-1990	DE 3905730 A1	30-08-1990
		AT 89406 T	15-05-1993
		DE 8916216 U1	06-04-1995
		DE 59001395 D1	17-06-1993
		EP 0387520 A2	19-09-1990
		JP 1898148 C	23-01-1995
		JP 2266224 A	31-10-1990
		JP 6023662 B	30-03-1994
US 4758720 A	19-07-1988	DE 3542514 A1	04-06-1987
		CH 672679 A5	15-12-1989
		JP 62133306 A	16-06-1987

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

EPO FORM P0481

3/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013808523 **Image available**

WPI Acc No: 2001-292735/200131

XRPX Acc No: N01-209281

Device for position determination and calculation of alignment errors for

use with machine tools or coordinate measurement devices has combined scanning unit for both position and alignment measurements

Patent Assignee: HEIDENHAIN GMBH JOHANNES (HEIJ)

Inventor: SPANNER E

Number of Countries: 027 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1085291	A2	20010321	EP 2000119051	A	20000902	200131 B
DE 10043635	A1	20010322	DE 10043635	A	20000902	200131
JP 2001141521	A	20010525	JP 2000276659	A	20000912	200136
US 6907372	B1	20050614	US 2000661663	A	20000914	200540

Priority Applications (No Type Date): DE 199044395 A 19990916

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 1085291	A2	G	9	G01B-005/00	

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

	LI	LT	LU	LV	MC	MK	NL	PT	RO	SE	SI
DE 10043635											
JP 2001141521											
US 6907372											

Abstract (Basic): EP 1085291 A2

NOVELTY - Device has a position scale (10) with graduation divisions (11.1, 11.2) and guide error scales (12a, 12b) arranged perpendicularly to the position scale. Combined position and guide error scanning units (20, 30) are arranged above the scales so that they move relative to the scales.

DETAILED DESCRIPTION - A common light source is used for scanning both scales.

USE - Position measurement for precision machine tools or coordinate measurement devices with additional determination of guide errors or alignment errors. Determined alignment errors are then used with position measurements for a precise determination of the position of the machine tool.

ADVANTAGE - Only once scanning arrangement is needed for both measurement and alignment determination.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Figure shows a plan view of the measurement arrangement.

position scale (10)
graduation divisions (11.1, 11.2)
alignment or guide error scales (12a, 12b)
position and alignment error scanning units. (20, 30)

pp; 9 DwgNo 1/3

Title Terms: DEVICE; POSITION; DETERMINE; CALCULATE; ALIGN; ERROR;
MACHINE;

TOOL; COORDINATE; MEASURE; DEVICE; COMBINATION; SCAN; UNIT; POSITION;
ALIGN; MEASURE

Derwent Class: S02

International Patent Class (Main): G01B-005/00; G01B-021/00; G01D-
005/34;

G06F-015/00

International Patent Class (Additional): B23Q-017/00; G01B-011/00;

G01B-011/30; G01D-005/36; G01D-005/38; G02B-005/18; H03M-001/22

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): S02-A03B4; S02-A06A3

?